

第 54 回マイクロファブリケーション研究の最新動向
～細胞イメージング、研削加工におけるグリッパ解析、Ti の鏡面研削における粗さ改善～
同時開催：**第 13 回板橋オプトフォーラム**

開催日時：令和 8 年 10 月 2 日（金）

開催場所：板橋区立グリーンホール

開催形態：ハイブリッド ※WEB 参加の方には参加登録後に接続情報が通知されます(基調講演は対面聴講のみ)。

共催：板橋区、国立大学法人宇都宮大学オプティクス教育研究センター、日本光学会

協賛：板橋区産業振興公社、公益社団法人砥粒加工学会、一般社団法人電気加工学会、一般社団法人日本塑性加工学会、一般社団法人日本オプトメカトロニクス協会、公益社団法人精密工学会、一般社団法人日本機械学会、公益社団法人日本セラミックス協会

——プログラム——

10:30-10:40 開会

10:40-11:00 特別セッション：

① 微細加工関連の最新研究について

理化学研究所大森素形材工学研究室 大森 整 氏

11:00-12:00 ②横河電機の細胞イメージング技術と創薬の新たな可能性

横河電機株式会社 中西 慶子 氏（調整中）

13:15-14:15 基調講演：

光でみる、光をみる—宇宙線観測最前線—

東京大学宇宙線研究所 教授・所長 荻尾 彰一 氏

14:30-15:30 トライボセッション：

最適加工のためのインプロセス計測技術の紹介

(株)ナガセインテグレックス／大森素形材工学研究室 井村 諒介 氏

15:30-16:00 休憩

16:00-16:30 マイクロセッション：

ELID ラップ研削による Ti の鏡面研削における粗さ改善の試み

理化学研究所 大森 整 氏

16:30-16:45 総括、今後の予定、閉会

参加ご希望の方は、ご所属、ご住所、ご芳名、ご連絡先（TEL, FAX, E-mail）、現地参加/WEB 参加の別を記載の上、
E-mail: micro@e-micro.org までお申し込みください。
本シンポジウムは、理研シンポジウムの一環として行われています。